

SAM-8C

セミオートウェーハマウンター Semi-Automatic Wafer Mounter with Vacuum Chamber

【概要 - Outline -】

◆ダイシング前工程としての専用フレームへのウェーハマウントするセミオート機です。

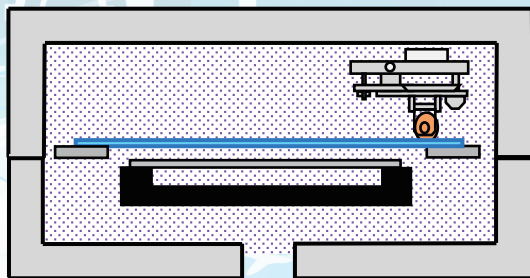
Semi-automatic wafer mounter which mounts wafer & tape on film frame for dicing process.

真空チャンバー使用によりマウント中にダメージを与えません。

Vacuum chamber makes no damage onto wafer in mounting.

【特長 - Features -】

- ◆ウェーハを真空状態でテープに貼り付けることにより、気泡の発生が無く、ウェーハにダメージも与えません。
No air bubble, nodamage for wafer by mounting wafer in vacuumed atmosphere.
- ◆ウェーハパターン面、外周 3mm 以外保持によるコンタクトレステーブルを採用。(ウェーハ吸着は不要です)
Contactless mounting table which holds wafer at 3mm edge part. (the vacuum to hold wafer is not necessary.)
- ◆ウェーハマウント位置と、フレームテープ貼り付け位置を別々に配置することにより、テープの使用量が少なく済み、1枚のウェーハマウント中に別の1枚のフレームのセッティングが可能とな為、作業効率も上がります。
Saving tape consumption, possible to set other frame in wafer mounting, contributing operation efficiency by separating wafer mounting part.
- ◆テープの送り、巻き取り、カットは自動で、離ケイ紙巻き取りシステムも可能です。(UVテープ使用可能)
Automatic tape supply, tape coiling, wastage tape coiling, tape cutting. (UV tape applicable)
- ◆タッチパネルでテーブル高さ調整可能
Table height can be controlled byu touch panel



タッチパネルで
テーブル高さ調整
Table height controlled by
touch panel

真空チャンバー
Vacuum chamber



信頼の中国工場
Reliable China factory

| 仕様 Specification | SAM-8C | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| 対応ウェーハサイズ Wafer Size | 4・5・6・8 inch | |
| フレームサイズ Frame Size | 2-6-1 / 2-8-1 | |
| タクトタイム Throughput | 35 秒 / 枚 (2枚目以降セット時間除く) (ご使用条件により異なります) 35 sec/wafer (from 2nd wafer expect the operator is handing time) (Depend on data setting) | |
| ユーティリティ Utilities | 電源 Power | AC200V 単相 Single phase 50/60Hz 1.5KVA |
| | 空気源 air | 圧力 Pressure 0.5Mpa 30NI/min |
| | 真空減 Vacuum source | コンバム使用 Using venturi valve |
| 装置寸法 Demension | W 810 × D 1,330 × H 1,480 mm | |
| 重量 Weight | 365 kg | |
| 原産国 Country of origin | 中国 China | |

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.